

期刊信息

篇名	Surface Wettability of Nitrogen Plasma-Implanted Silicon
语种	英文
撰写或编译	
作者	G. J. Wan,R. K. Y. Fu,P. Yang,J. P. Y. Ho,X. Xie,N. Huang,and P. K.Chu*
第一作者单位	
刊物名称	Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
页面	xx (2005)xxx-xxx (已
出版日期	2005年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	Si(C)-N系薄膜的血液接触活化机理及抗凝血优化